

## **МИКРОКАНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КОРПУСКУЛЯРНОЙ И РЕНТГЕНОВСКОЙ ЭМИССИИ ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ**

Л.З. Барабаш, Б.Н. Брагин, А.А. Голубев, А.И. Громов, Ю.А. Захаренков,  
В.С. Малышева, А.И. Никитенко, Т.Ф. Никитина, Г.В. Рязанов, Р.Т. Хайдаров,  
Б.Ю. Шарков, О.Б. Шамаев, А.С. Шиканов

УДК 621.3837.8

*Разработан микроканальный анализатор для регистрации изображений в различных спектральных диапазонах рентгеновской и корпускулярной эмиссии лазерной плазмы. Проведена калибровка чувствительности в области рентгеновского излучения 1 – 19 кэВ и энергии ионов 1 – 10 кэВ.*

В исследованиях по лазерному нагреву и сжатию сферических мишений /1/ большое значение имеет обеспечение однородности облучения и симметрии создаваемой плазменной короны и сжимаемой неиспаренной части мишени. В связи с этим одной из основных задач диагностики является разработка специальной аппаратуры, позволяющей регистрировать изображение высокотемпературной плазмы с пространственным разрешением  $10^{-2}$  мм и временным разрешением  $10^{-10}$  с. Ранее для этих целей широко применялись рентгеновские фотоэмulsionии /2/ и пленочные трековые детекторы /3/, регистрирующие в камерах-обскурах изображение рентгеновского и ионного источника. Эти устройства технически просты, но отсутствие временного разрешения и низкая чувствительность в диапазоне жестких ( $h\nu > 8$  кэВ) квантов и энергии ионов менее 100 кэВ ограничивают область их применения. Перспективным решением перечисленных проблем является применение приборов на основе микроканальных пластин /4/, чувствительных как к рентгеновскому излучению, так и к корпускулярным потокам.

В работе разработан микроканальный анализатор (МКА) для регистрации изображений в различных спектральных диапазонах рентгеновской и корпускулярной эмиссии лазерной плазмы. Схема анализатора представлена на рис. 1. На входе на расстоянии А от мишени (1) расположены камеры-обскуры (3), часть из которыхкрыта для регистрации ионов, а часть закрыта фильтрами различной толщины из бериллия и алюминия (2) для регистрации мягкого и жёсткого рентгеновского излучения. Микроканальная плас-

тина (МКП) (4), расположенная на расстоянии В от камер-обскур, преобразует поток рентгеновского, ультрафиолетового излучений и ионов в электронный. Внешний диаметр МКП 40 мм, диаметр каналов (13 мкм) определяет пространственное разрешение. Электронный поток усиливается в МКП в  $10^2 - 10^4$  раз (в зависимости от величины напряжения на МКП) и далее передается плоскопараллельным полем 5 кВ на алюминированный люминесцентный экран (5), нанесенный на волоконно-оптическую пластину, где преобразуется в видимое излучение. Регистрация изображений осуществляется высокочувствительной фотопленкой (Фото-250) (6), прижимаемой к поверхности волоконно-оптической пластины.

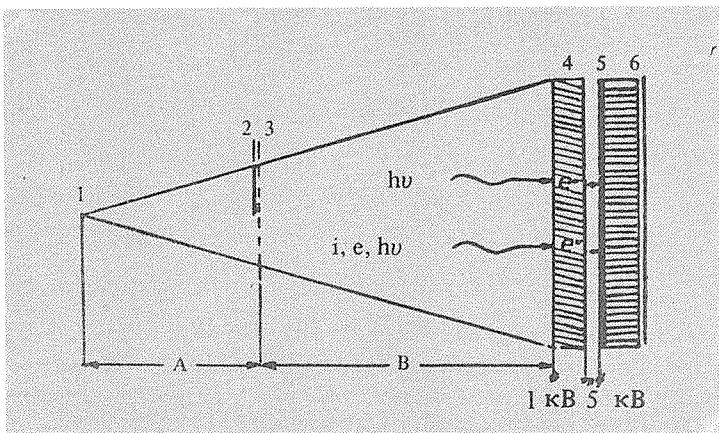
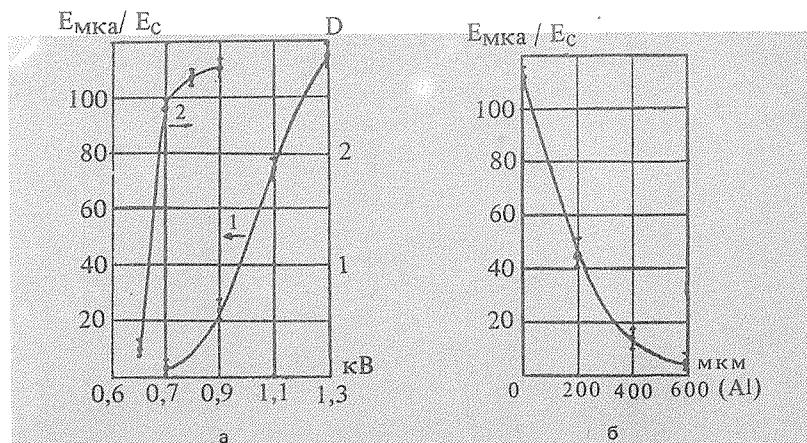


Рис. 1. Схема микроканального анализатора.

Калибровка спектральной чувствительности МКА в области жесткого рентгеновского излучения ( $h\nu > 3$  кэВ) производилась на непрерывном рентгеновском микроскопе-анализаторе МИР-3 (энергия электронного пучка 3–19 кэВ), а в области мягкого рентгеновского излучения ( $h\nu = 1-3$  кэВ) и энергий ионов 1–10 кэВ – в импульсном режиме на плазменном источнике, создаваемом  $\text{CO}_2$ -лазером на твердой свинцовой мишени.

Для согласования с конструктивными особенностями установки МИР-3 (выходное бериллиевое окно толщиной 150 мкм не допускало использования открытого МКА) был изготовлен отпаянный МКА со слюдяным окном толщиной 20 мкм. Калибровка проводилась путем сравнения светового выхода МКА ( $E_{\text{MKA}}$ ) и эталонного сцинтиллятора  $\text{NaI}(\text{Tl})$  ( $E_c$ ), измеряемых селеновым фотоэлементом Ф107. При этом учитывалось, что максимум

свечение сцинтиллятора (410 нм) близок к максимуму свечения МКА (450 нм). Спектр рентгеновского излучения контролировался рентгеновскими фотопленками по методу фильтров. При напряжении 13 кВ на рентгеновской трубке с медной мишенью основная доля энергии излучается в К-линиях (длина волны линии  $K_{\alpha}$  равна 1,542 Å (8,04 кэВ),  $K_{\beta} = 1,392$  Å (8,9 кэВ)).



Р и с. 2. Калибровочные характеристики МКА. а) Зависимость усиления от напряжения на МКП: 1 – рентгеновское излучение, толщина Ве фильтра 150 мкм, напряжение на трубке 13 кВ; 2 – ионная эмиссия, расстояние до плазмы 130 см. б) Относительный световой выход МКА на длине волн 1,54 Å (Cu  $K_{\alpha}$ ).

В экспериментах с CO<sub>2</sub>-лазером (энергия 10 Дж в импульсе длительностью 200 нс, плотность потока энергии  $3 \cdot 10^10$  Вт/см<sup>2</sup>) плазма создавалась на поверхности свинцовой мишени. В качестве диафрагмы МКА использовалась прямоугольная щель размером 0,2x20 мм<sup>2</sup>, устанавливаемая на различных расстояниях А (от 25 до 100 см) от мишени, расстояние В составляло 100 см. Для получения создаваемого ионами изображения щели применялся высоковольтный блок импульсного ( $\tau_i \sim 20$  мкс) питания МКП с переменной задержкой относительно лазерного импульса. Временная задержка  $\Delta t \geq 10$  мкс позволяла полностью устраниТЬ влияние световой и рентгеновской засветки МКА. Для фотографирования изображения щели, формируемого ионами с заданной энергией, фиксировалось время пролета базы мишень – МКП соответствующим подбором времени включения МКП. Вследствие большой плотности тока ионов ( $\sim 10$  мА/см<sup>2</sup>) не требовалось значи-

тельного усиления, поэтому МКА использовался в основном как ионно-электронный конвертор с визуализацией распределения интенсивности в по-перечном сечении ионного пучка. На рис. 2а представлены зависимости усиления МКА от напряжения на МКП. Для жесткого рентгеновского излучения (кривая 1), генерируемого при напряжении на трубке 13 кВ и прошедшего через бериллиевое и сплюдяное окна, чувствительность МКА превосходит чувствительность сцинтиллятора во всем диапазоне напряжений на МКП, причем линейный участок характеристики, находящийся в интервале 0,85 – 1,2 кВ, перекрывает динамический диапазон  $\sim 10$ .

На рис. 2б показана спектральная чувствительность МКА по отношению к чувствительности сцинтиллятора (напряжение на трубке 13 кВ, напряжение МКП 1,3 кВ). Даже в наиболее жесткой части с энергией отсечки квантов 16 кэВ чувствительность МКА в 5 раз превосходит чувствительность сцинтиллятора NaI(Tl), расположенного за Be фильтром толщиной 150 мкм.

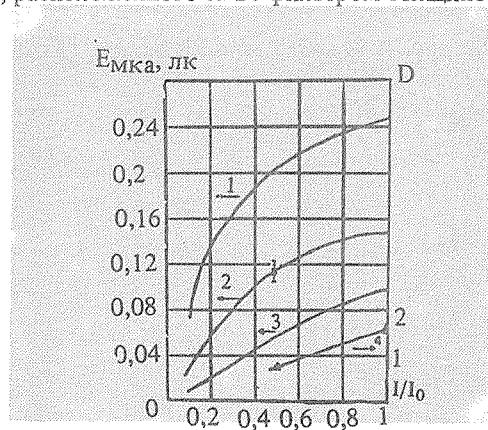


Рис. 3. Зависимость светового выхода МКА от амплитуды сигнала для толщины фильтров: 1 – 150 мкм Be; 2 – 150 мкм Be + 100 мкм Al; 3 – 150 мкм Be + 200 мкм Al; 4 – ионный пучок,  $\Delta t = 10$  мкс ( $E_i < 10$  кэВ).

Зависимость светового выхода МКА от амплитуды выходного сигнала, изменяемого путем удаления от точечного источника, представлена на рис. 3. В случае регистрации ионного пучка показана зависимость плотности почертования фотопленки D (кривая 4). Кривые 1 и 2 демонстрируют переход МКС из линейного режима в режим насыщения, когда необходимо, в соответствии с

характеристикой усиления (рис. 2а), уменьшать напряжение на МКП. Кривая З характеризует линейный режим МКА с динамическим диапазоном не менее 10.

Проведенные калибровочные измерения показали, что МКА, обладая высоким пространственным и, в случае импульсного питания, временном разрешением, является высокочувствительным детектором ионной и рентгеновской эмиссии и может быть применен для диагностики ионных пучков и лазерной плазмы, а также для прецизионного анализа изображений микрообъектов.

Поступила в редакцию 24 января 1985 г.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Б а с о в Н.Г. и др. Нагрев и сжатие термоядерных мишеней, облучаемых лазером. Итоги науки и техники, сер. радиотехника, 26, М., изд. ВИНИТИ, 1982.
2. К о л о г р и в о в А.А. и др. Квантовая электроника, 2, 2223 (1975).
3. Slater D.C. Appl. Phys. Lett., 31, № 3, 196 (1977).
4. Брагин Б.Н. и др. ПТЭ, № 4, 158 (1975).